

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団

「半導体製造体験」 講座のご案内

半導体の製造におけるリソグラフィ工程（レジスト塗布/露光・現像/エッチング）を九州大学のクリーンルームにて1日で体験します。半導体関連業務に従事していても実際の製造現場を知らないまたは経験のない技術者におすすめする講座です。

講座内容

※一部変更になる場合がございます

【実習概要】

PチャネルMOSFETをシリコン基板上に集積化した論理回路(NAND)を例題として取り上げ、集積回路(IC)製造プロセスの一部(リソグラフィ工程)を行うとともに、MOSFETと論理回路の動作特性を計測・評価します。

1. IC製造プロセス（講義）

2. 実習に用いる装置・材料の説明（講義）

3. IC製造（実習） クリーンルームにて

- (1) レジスト塗布
- (2) 露光・現像
- (3) エッチング



4. ICの計測（実習）

- (1) MOSFETのしきい値電圧の評価
- (2) 3入力NAND回路の動作特性の計測



5. データ整理とまとめ

PC（カレッジで準備）を使って
データ整理を行い、各自発表していただきます。

※クリーンルームでは防塵服を着用します。手続き簡略化のため
サイズはLL(身長～182cm、胸囲～112cm)に統一させていただきます。
もしLLより大きなサイズが必要な場合は受講申込時にご連絡ください。
また受講申込時に靴のサイズも確認させていただきます。
なお防塵服着用のためスカートでの参加はご遠慮ください。

＜実習について＞

「3. IC製造（実習）」と「4. ICの計測（実習）」は
2グループ（1グループ3人×2グループ）に分かれて
午前と午後で実習内容を入れ替えながら実施します。

開催日

1回目:令和4年11月7日(月) 10:00～17:00

2回目:令和4年12月20日(火) 10:00～17:00

会場

〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学伊都キャンパス
ウエスト2号館 5階 547号室(第2会議室)

講師

九州大学 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 電子デバイス工学
准教授 佐道 泰造 氏

受講料

無料

定員

6名 /回 ※応募者多数の場合は調整させていただきます。

申込み

開催日3日前（土日祝日を除く）までに、
右記システム開発技術カレッジの講座案内よりお申込みください。



「半導体インテグレーション
技術者育成研修」申込

https://ist-college.org/seminar/apply_form/entry-60.html